

纳米粒子的分散・凝集・相互作用・表面改质的评价

Zeta电位・粒径・分子量测量系统

Zeta-potential & Particle Size Analyzer

ELSZNEO

扫描观看视频



Zeta电位

粒径
0.6nm ~
10 μm

分子量
340 ~
 2×10^7

浓度范围 0.00001% ~ 40%

温度范围 0°C ~ 90°C

测量项目

■ 粒径 ■ Zeta 电位 ■ 分子量 ■ 粒子浓度 ■ 微流变 ■ 凝胶网络构造解析

- 多角度测量, 高分辨率测量粒度分布
- 在高盐浓度下测量平板状样品的表面 Zeta 电位
- 微量(3 μL ~)测量粒径
- 测量粒子浓度
- 进行微观流变测量
- 评估凝胶网络结构和异质性
- 一个样品池即可连续测量粒径和zeta电位
- 温度梯度功能对蛋白质等进行变性和相变温度分析
- 通过电渗流的实际测量和分析, 提供高精度的Zeta电位测量结果



Zeta电位・粒径・分子量测量系统

Zeta-potential & Particle Size Analyzer

ELSZNEOSE

测量项目

■ 粒径 ■ Zeta 电位

- 根据用途选配追加功能(分子量测量・粒子浓度测量・微流变测量・凝胶网络构造解析・粒径多角度测量)
- 使用标准flow cell可连续测量粒径和Zeta 电位
- 能够测量从稀薄溶液到浓厚溶液的宽浓度范围的粒径和Zeta电位
- 在高盐浓度下测量平板状样品的表面Zeta 电位(选配)

多样品纳米粒径测量系统

nanoS $\wedge$ QL $\wedge$

兼具「高性能」和「使用简单」 可对应从希薄～浓厚溶液的宽广浓度范围

粒径	0.6nm～10 μ m
----	------------------

浓度范围	0.00001～40%* ¹
------	---------------------------

※1 PS Latex粒子：0.00001～10%，牛磺胆酸：～40%

温度范围	0～90℃* ²
------	---------------------

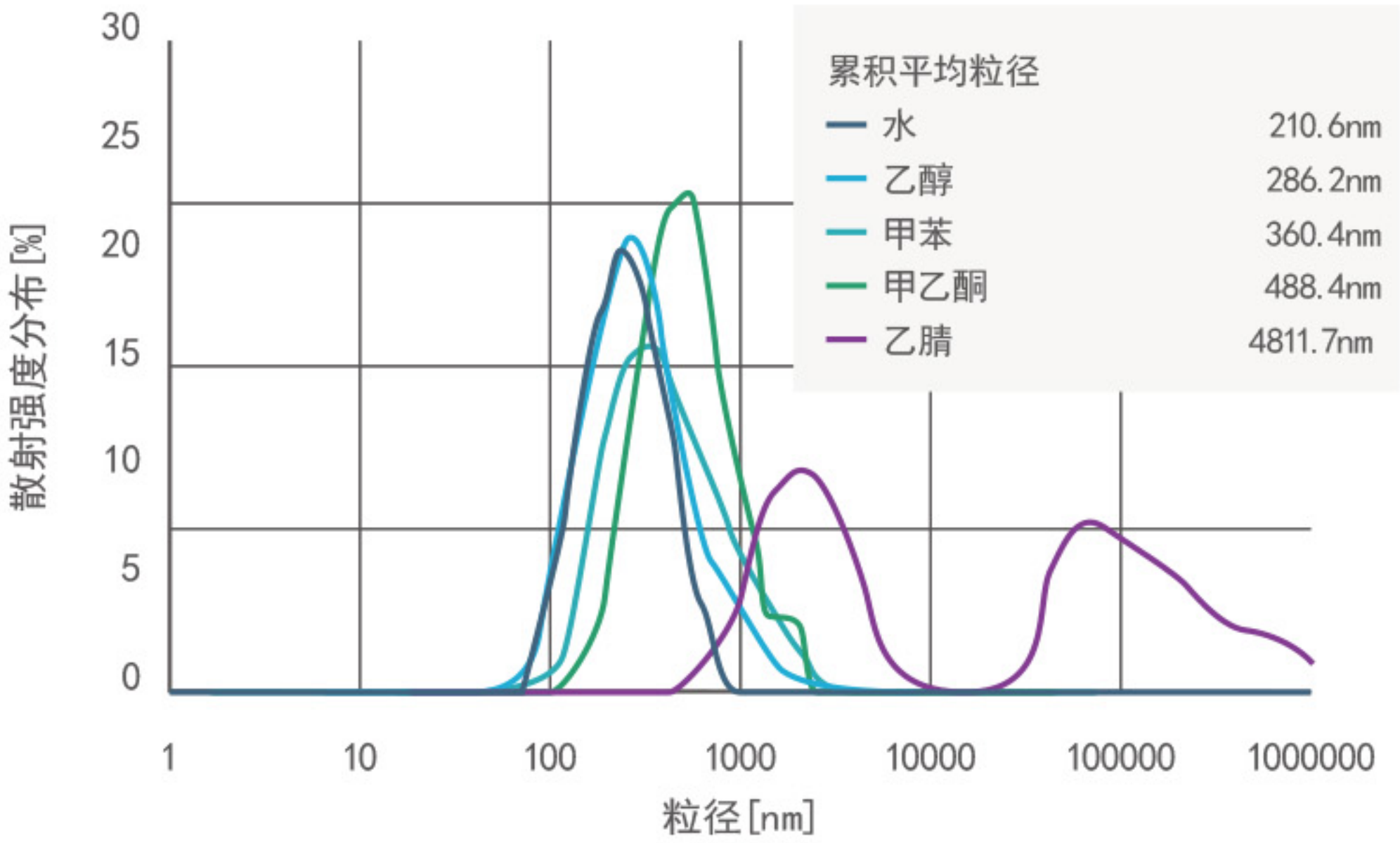
※2 在批量样品池中使用玻璃cell时

nanoS $\wedge$ QL $\wedge$

- 多可连续测量5个样品
- 只需要1分钟的高速测量
- 非浸入式，无污染
- 简单易懂的软件
- 搭载温度梯度功能

连续测量5个不同溶剂的样品

氧化铝粒径评价

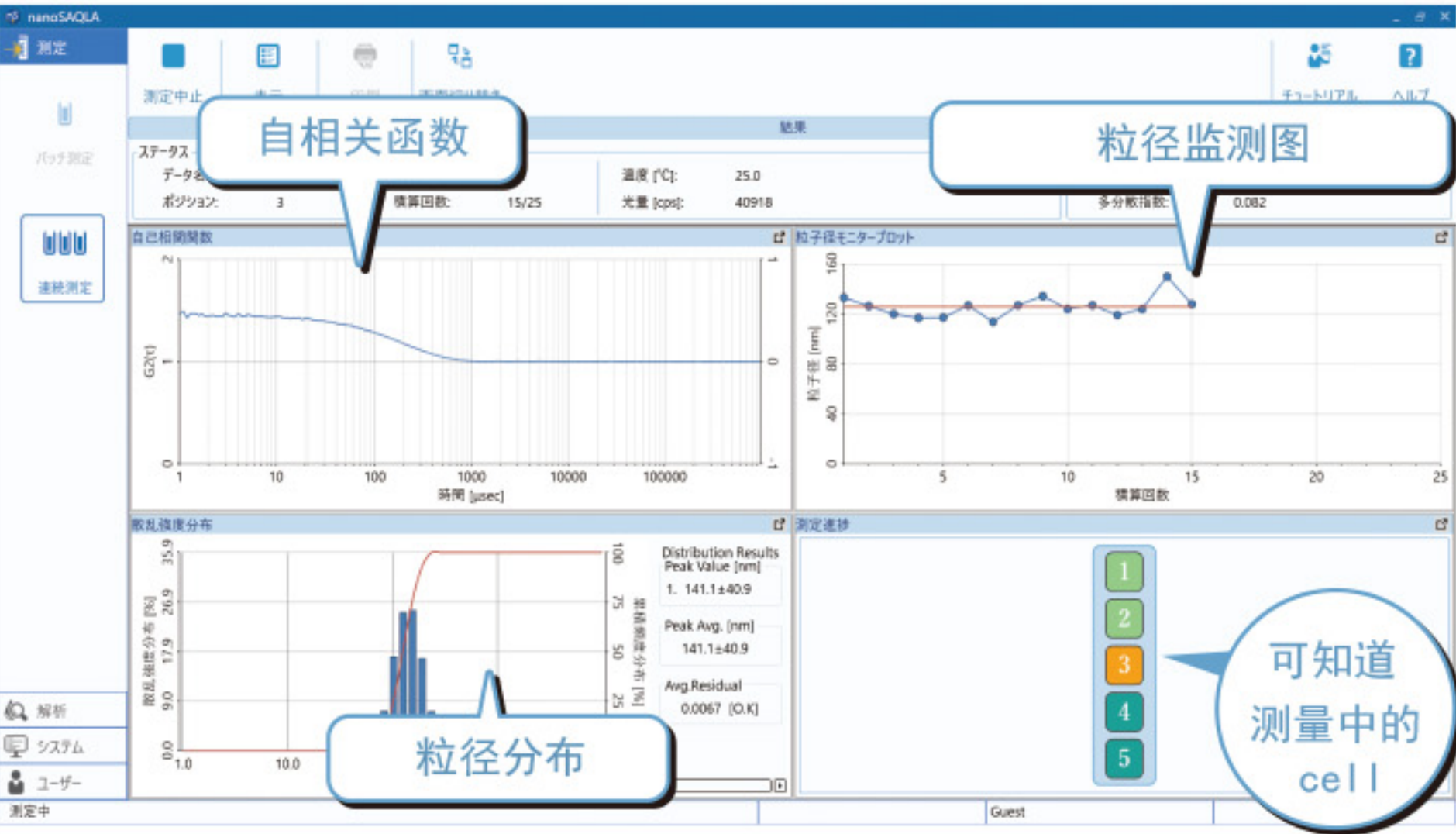


$\wedge$ S50

- 最大可连续测量50个样品
- 连续测量中也可追加样品
- 可以一次性更换预先在旋转台上放置好的cell

一眼即懂的测量画面

通过1个画面表示出测量中粒径变化的粒径监测图和确认粒径分布的合理性及自相关函数的残差图。



nanoS $\wedge$ QL $\wedge$



Auto Sample
 $\wedge$ S50

扫描二维码
观看视频



小角激光散射仪 PP-1000

采用小角光散射法，实时评价高分子、薄膜的构造变化

球晶径	1.3～175 μ m
-----	-----------------

相关长	0.1～100 μ m
-----	-----------------

- 简便・小型的小角光散射测定
- 将可视光产生的 μ m单位的相结构数值化
- 对温度变化过程进行高速动态测量

测量项目

- 聚合物结晶（球晶、针状结晶、微结晶等）
- 温度变化时的构造变化（动态测量）
- 高分子共混物的相分离结构（相关长）
- 由于拉伸和紫外线导致的构造变化（※需要咨询）

扫描观看视频
学习小角光散
射的基础知识



相位差测量设备

RETS-100nx

- 全波段高速测量
- 可测量任意波长下的高精度相位差
- 通过选择倾斜旋转样品台（选配），进行三次元折射率解析（Rth测量）
- 通过对轴角度补正功能（选配）高精度测量轴角
- 对应约0～60,000nm的广范围相位差
- 无需剥离、非破坏的测量多层贴合膜

测量项目

- 相位差（波长分散）
- 光轴
- Rth*¹，(Nx, Ny, Nz)*¹
- 偏光片吸收轴
- 偏光度、消光比
- 各种色度、各种透过率
- 液晶cell gap
- 预倾角*¹
- 扭曲角
- 配向角等

*1：必须配备自动倾斜旋转样品台（option）



线扫描膜厚仪® LS series

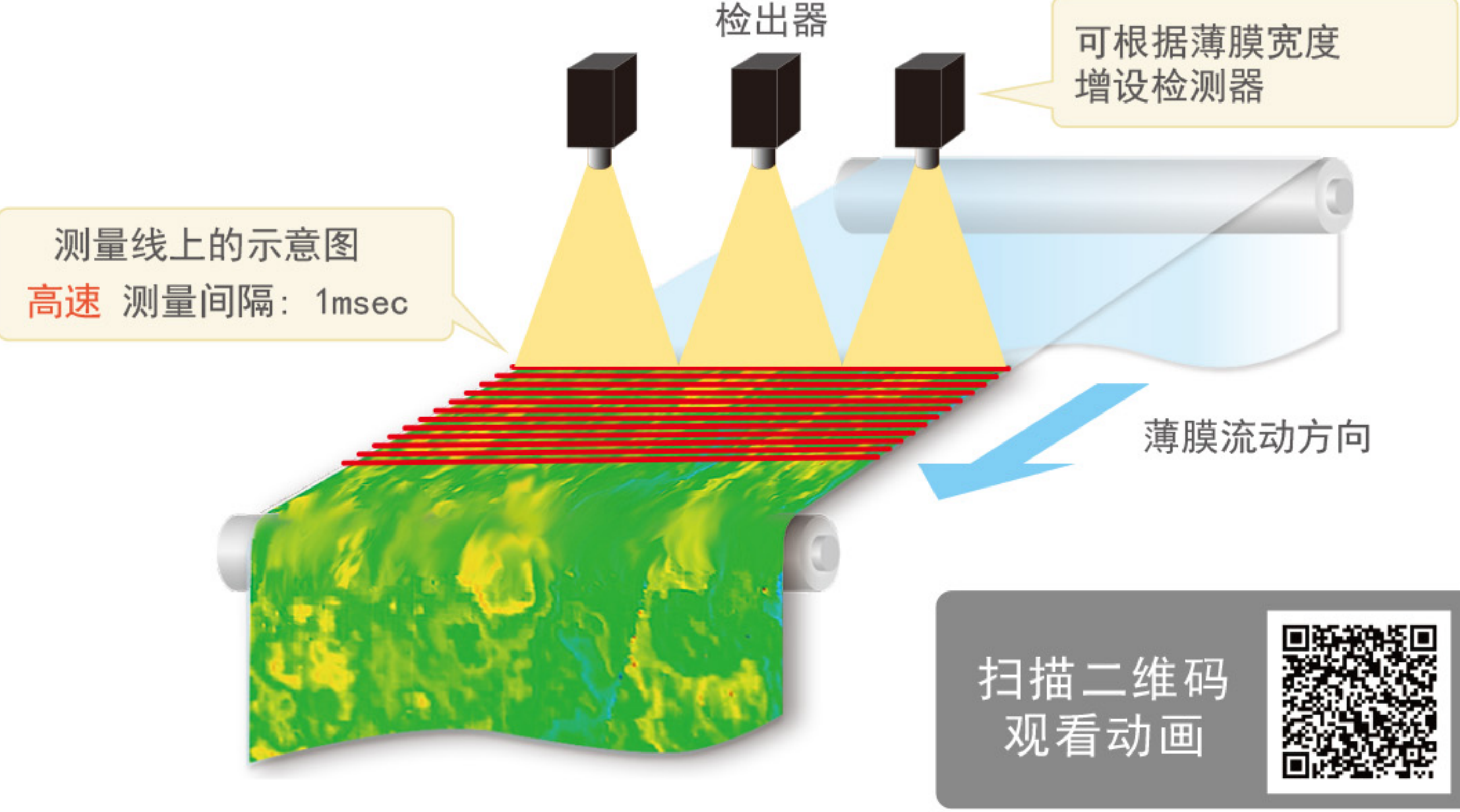
分光膜厚测量的先驱者，实现高精度全幅・全长测量

膜厚范围	0.1 ～ 300 μm*
测量间隔	1ms～

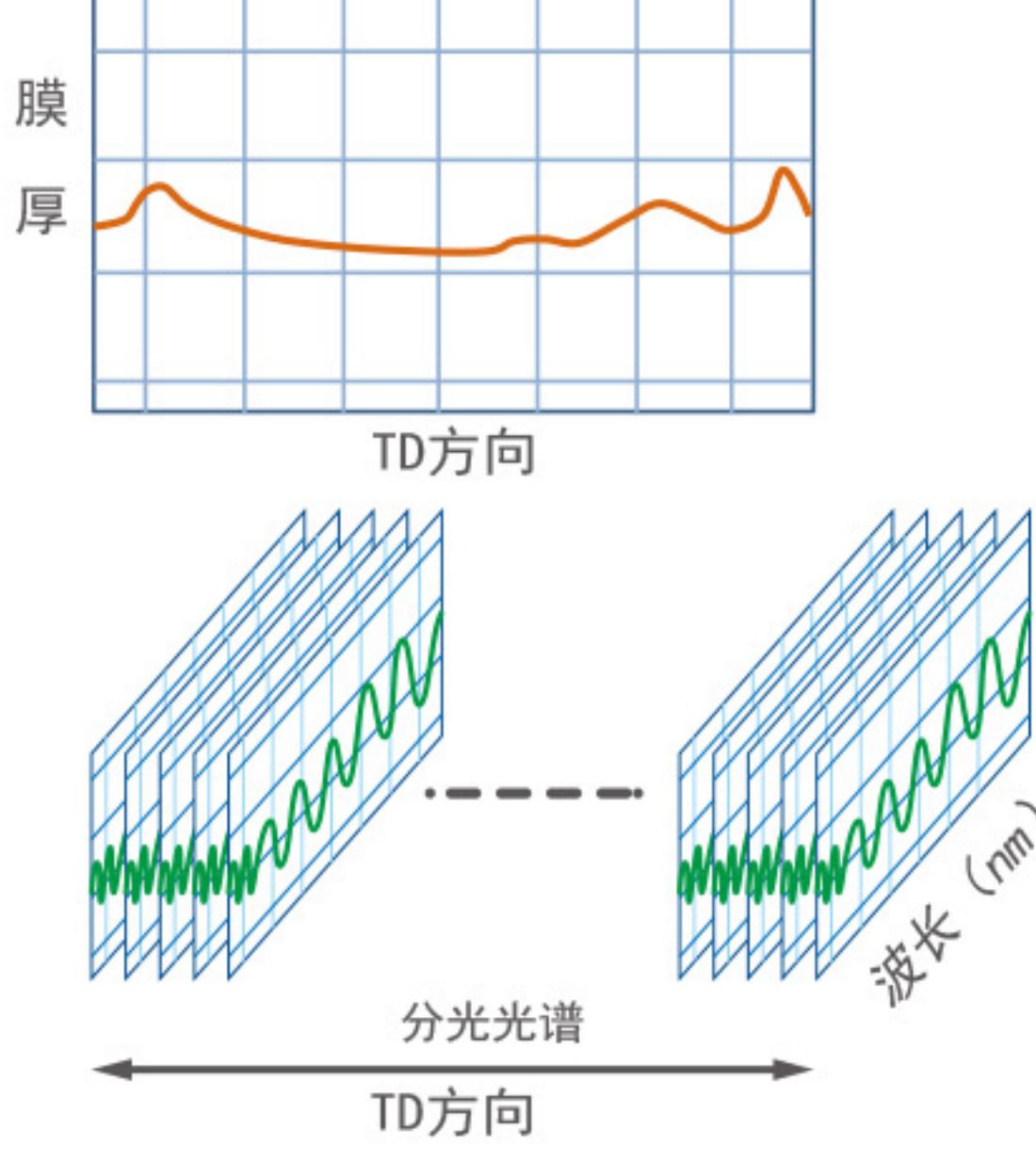
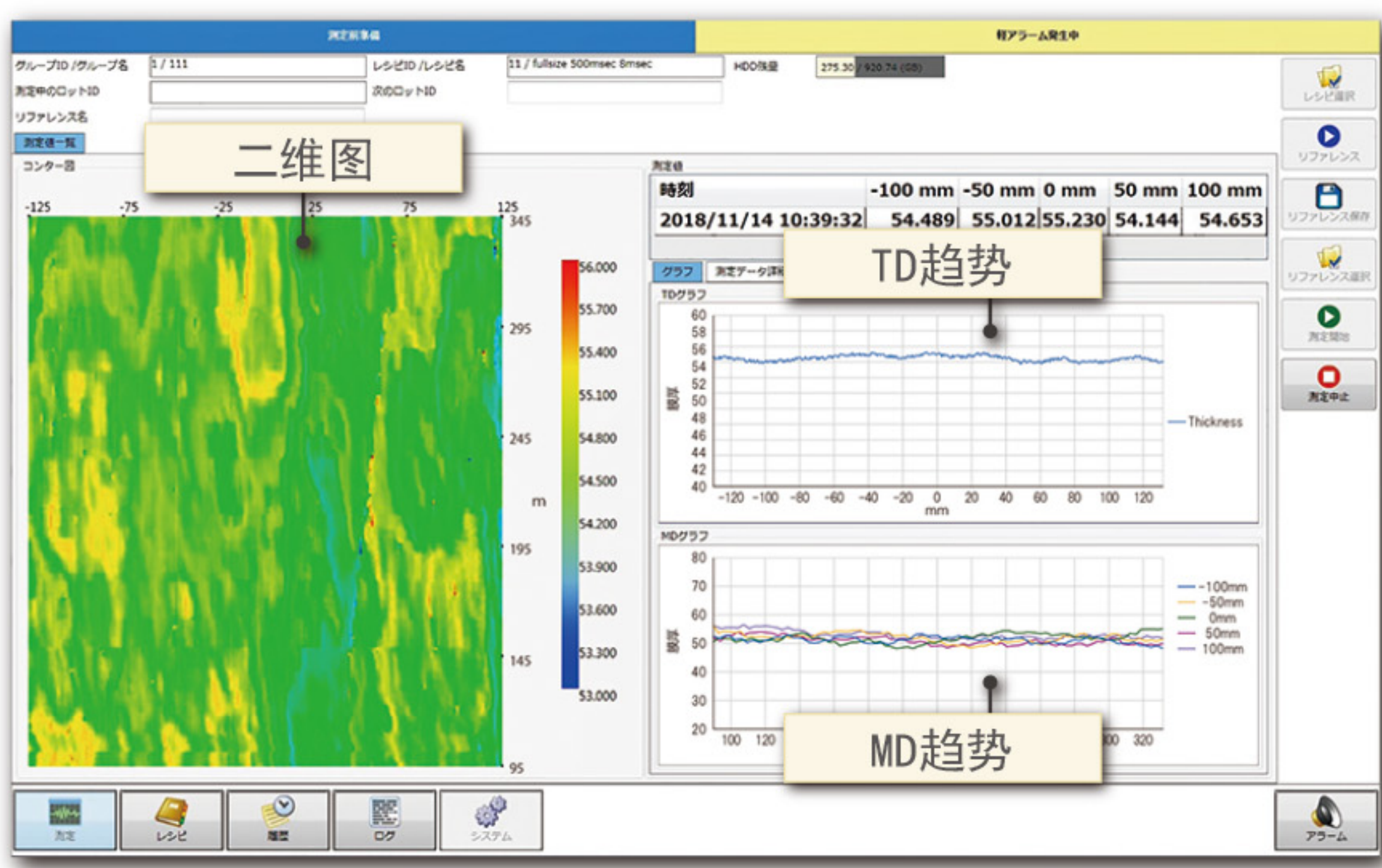
* 膜厚值n=1.5的膜厚的换算

- 采用线扫描方式无遗漏检测整面薄膜
- 最短1ms可测量500mm宽度的膜厚
(膜厚测量范围：0.1 μm～300 μm)
- 硬件・软件均为创新设计
- 作为专业膜厚测量厂商，提供多种支援

■ 全幅・全长测量示意图



■ 分析结果示例软件界面



在线型



离线型

瞬间多通道光谱仪 MCPD series

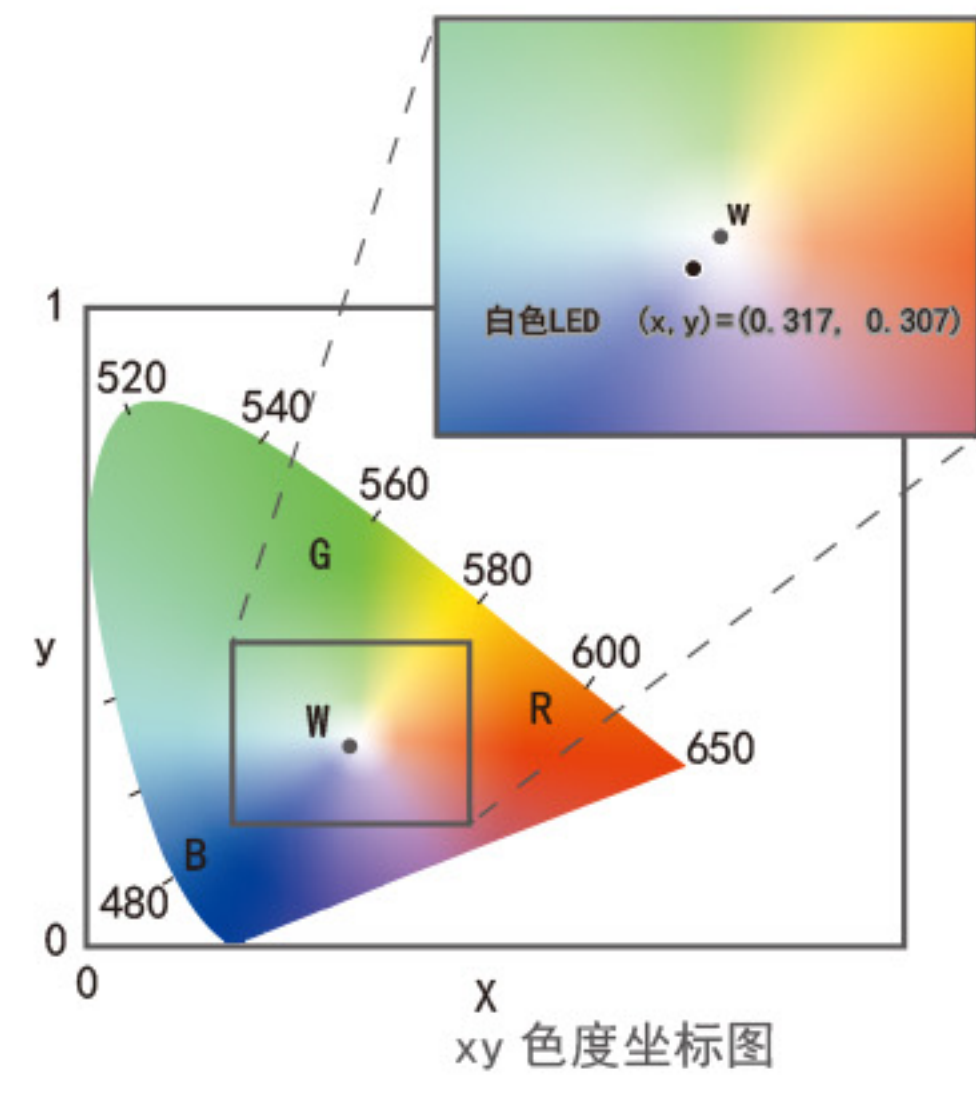
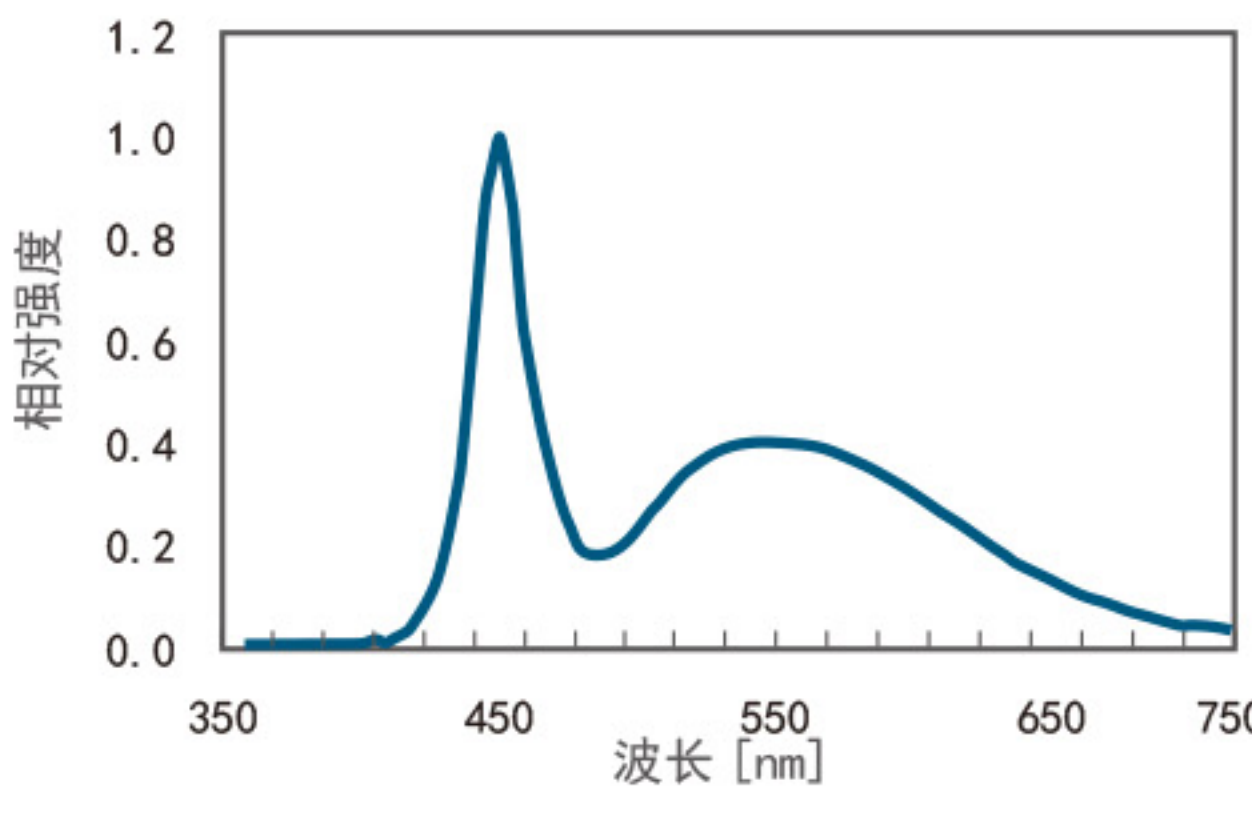
高速・高灵敏测量紫外・可视・近红外光谱

测量项目

- 发光光谱
- 反射率
- 透过率

- 与本公司旧机型相比，具有更宽动态范围・更低杂散光
- 实现了从5ms到65s的长跨度曝光时间的高再现性和直线性
- 通过柔性光纤和丰富的选配单元，实现自由的光学系
- 根据用途划分的丰富的产品阵容
满足JIS Z 8724要求的高性能分光器

■ 白色LED的光谱



发光光谱

龙门架对应系统

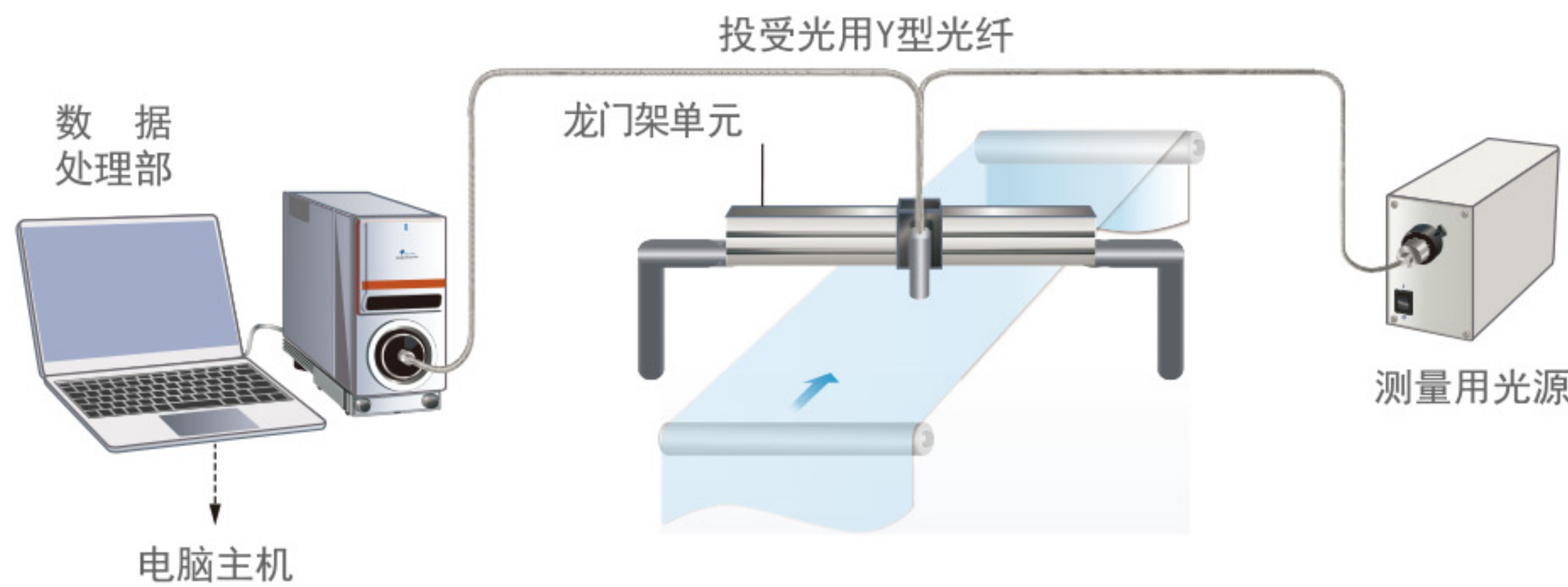
Online Measurement Traverse System

反射系

透透系

应用

- ◎功能性薄膜的品质管理
(HC、AR、ITO、燃料电池、锂电池)



防爆

多点测量点切换对应系统

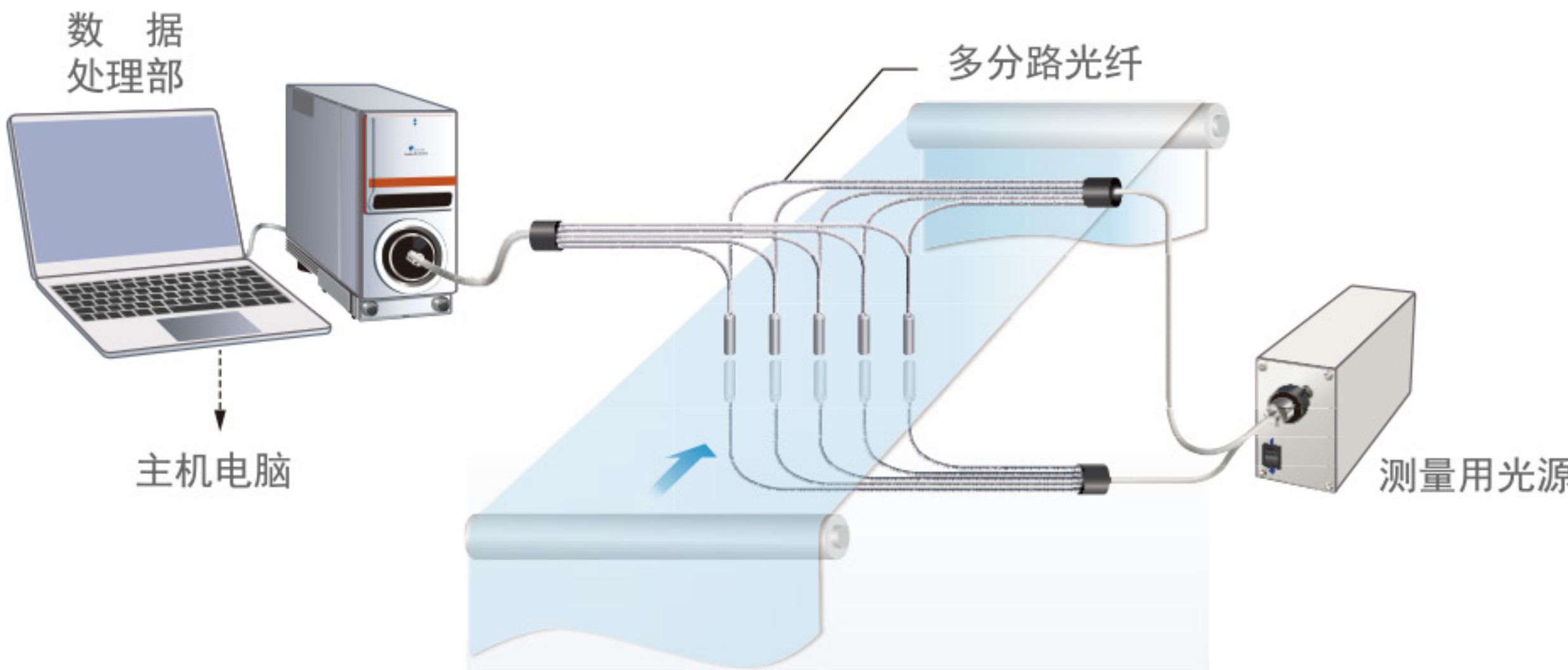
Multi-point Measurement System

反射系

透透系

应用

- ◎半导体晶圆上的膜厚、各种基板上的膜厚测量
- ◎各种基板上的膜厚测量



真空

防爆

耐热

与椭圆仪匹敌的高性能膜厚仪

显微分光膜厚仪

Optical Thickness Meter

OPTM series

薄膜

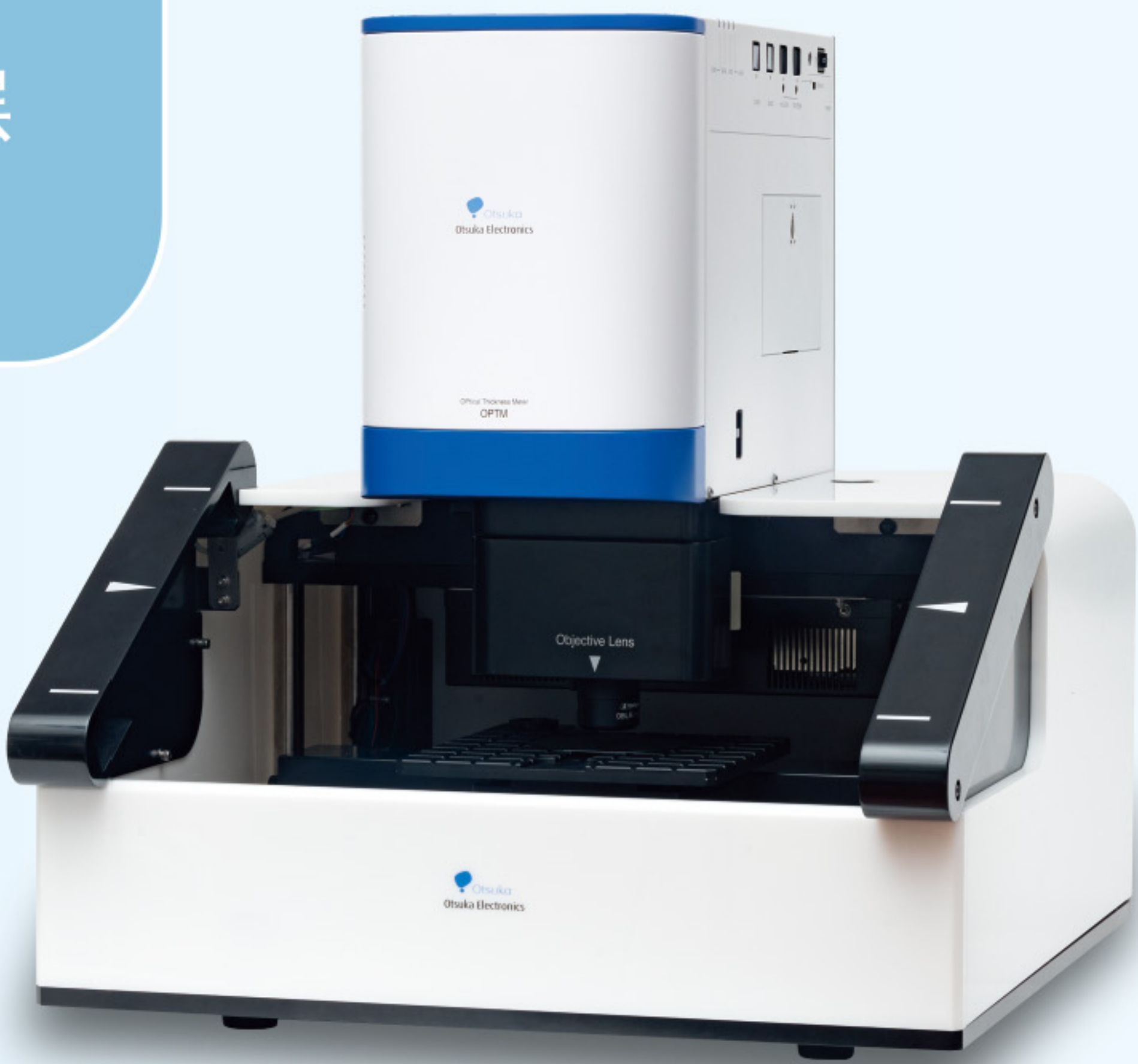
1nm ~ 92 μm

非接触
非破坏

1秒测量

多层

- 通过显微分光高精度测量绝对反射率(多层膜厚、光学常数n k)
- 实现微小领域的测量(光斑 φ 3 μm ~)
- 100nm以下薄膜也可高精度解析光学常数
- 拥有丰富的薄膜·玻璃等的透明基板的测量实绩
- 测量功能集中在头部,可嵌入自动测量设备

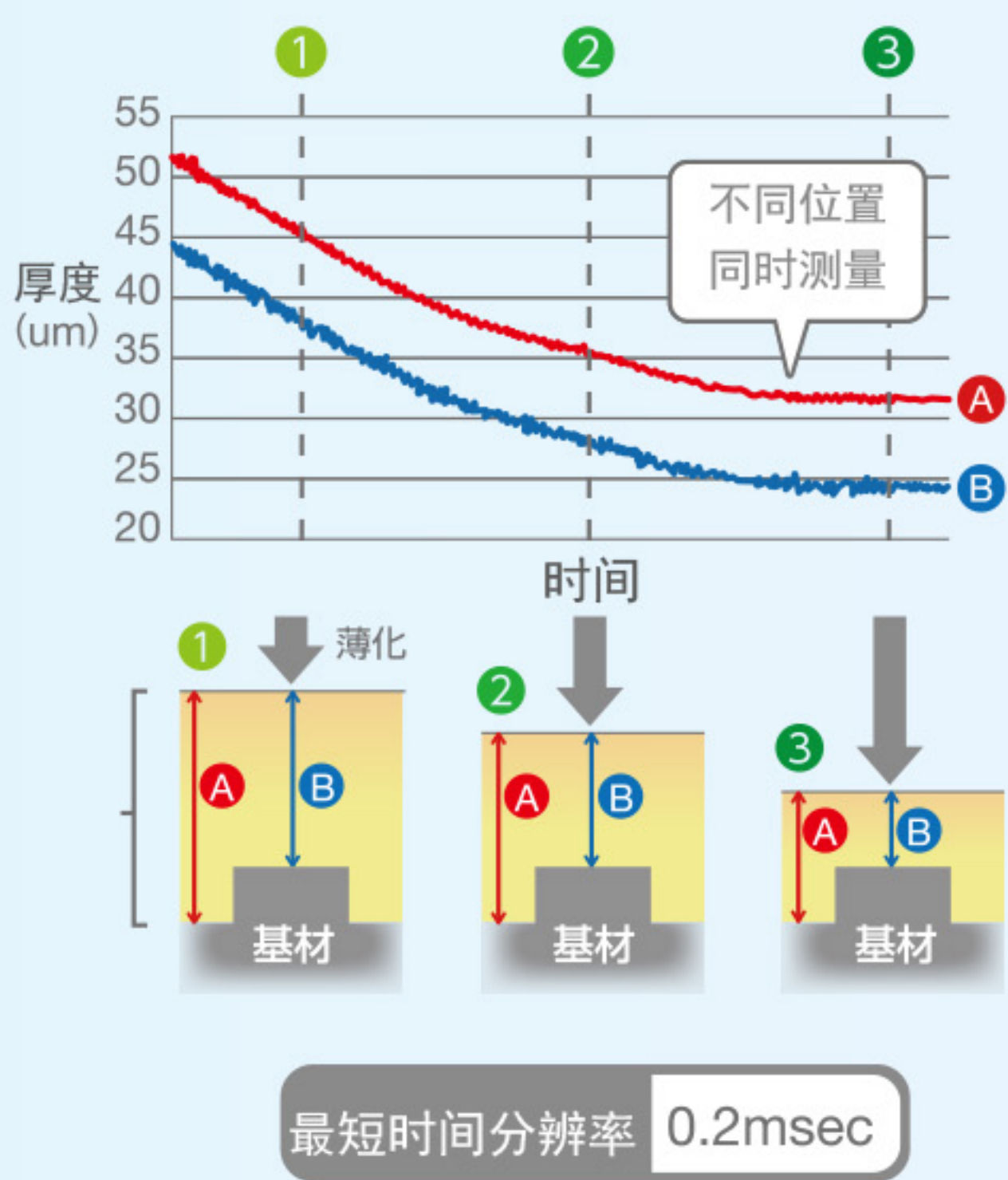


超高速分光干涉晶圆膜厚仪

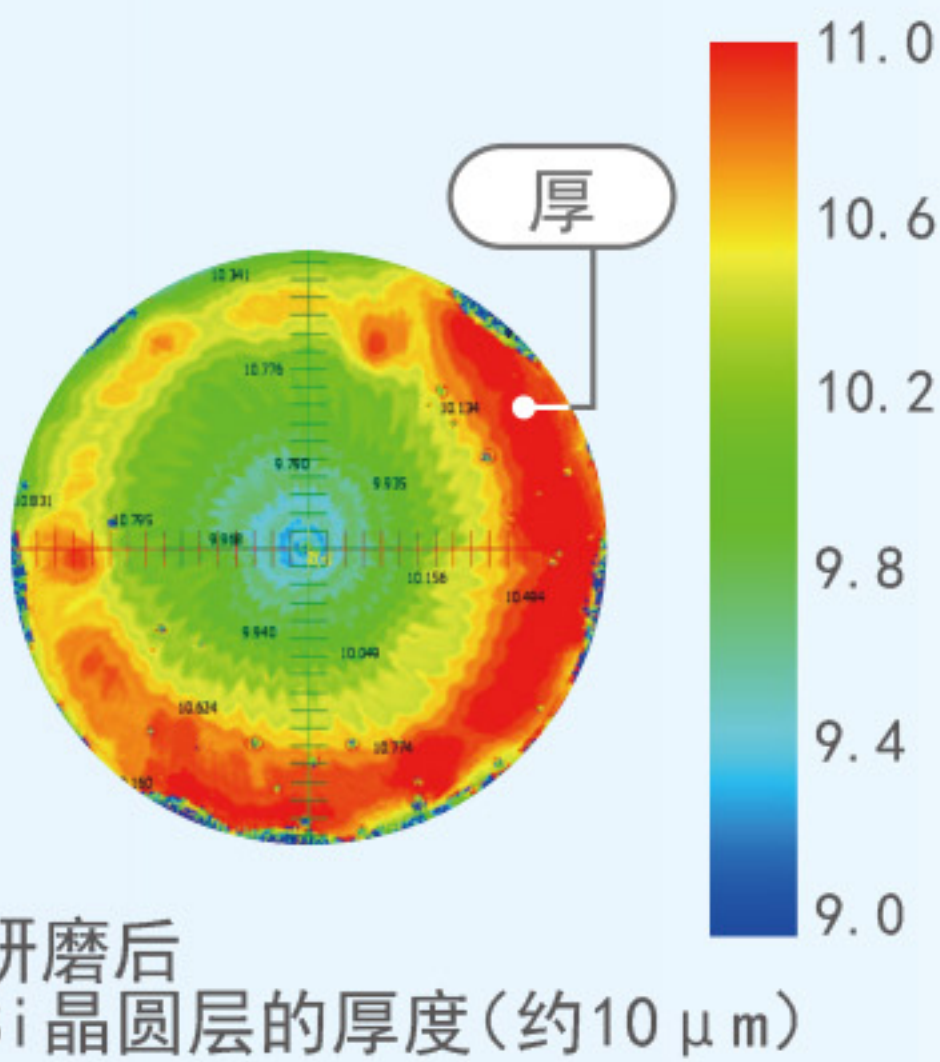
SF-3 series

- 高速·高精度非接触测量晶圆、树脂的厚度

厚度范围	6 μm ~ 1300 μm (Si换算) 10 μm ~ 2600 μm (树脂换算)
重复精度	0.01% 以下
测量光斑	约 φ 20 μm 以上



■ 超高速测量
可以实时跟踪加工过程



• 所列产品的外观和式样如有变更,恕不另行通知。
• 禁止擅自转载本目录的部分或全部内容。
• 公司名、商品名为各公司的商标·注册商标。

23.12.12

AS ONE
亚速旺(上海)商贸有限公司

information@mail.as-1.cn <https://www.asonline.cn/>

上海市黄浦区淮海中路755号新华联大厦东楼22楼B座
Block B, 22F, No.755 Middle Huaihai Road, Shanghai, China
TEL 021-5403-3266 FAX 021-5403-6091



更多内容尽在ASONLINE

亚速旺 搜索